



応用物理学会

第 21 回プラズマエレクトロニクス講習会

「プラズマプロセスの基礎から応用最前線」

実践的プラズマ制御技術～先進デバイスから環境基盤技術を中心に～

主催：応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会

日時：2010年10月28日(木)～29日(金)

場所：慶応義塾大学(日吉キャンパス)

来往舎 2F 大会議室

〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉 4-1-1

TEL：045-566-1101 (日吉研究支援センター)

会場へのアクセスおよびキャンパスマップ：

<http://www.keio.ac.jp/ja/access/hiyoshi.html>

内容／プログラム：

プラズマプロセスは、エレクトロニクス分野の先進デバイス開発の基幹技術であると共に、医療生体応用やエネルギー・環境応用を始めとする幅広い分野でも欠くことのできない基盤技術となりつつあります。この背景を踏まえ、本講習会では、研究開発・製造現場で必要とされるプラズマ制御、モニタリング技術の基本とその科学的基礎、並びに様々な分野へのプラズマ技術の応用最前線に関して、各分野にて第一線でご活躍の先生方をお招きし、講義を行います。特に、プラズマを利用している或いは利用を検討している方々が、中身(プラズマ)を知った上で装置を制御できる「実践的なプラズマ制御」を念頭に置いて、一般に経験的に理解されている事柄も科学的に分かり易く伝えられる講義となるよう企画しました。

10月28日(木) 10:00～18:00

1. プラズマの生成・制御

菅井 秀郎 (中部大学)

2. プラズマシミュレーション

田中 正明 (ペガサスソフトウェア)

3. プラズマ計測：光学的計測

佐々木 浩一 (北海道大学)

4. プラズマ計測：電気的計測

豊田 浩孝 (名古屋大学)

ポスターセッション・懇談会

10月29日(金) 10:00～16:40

5. プラズマプロセス表面過程とデバイスダメージ

江利口 浩二 (京都大学)

6. 大気圧プラズマ CVD による低温・高速成膜

垣内 弘章 (大阪大学)

7. 気体・液体プラズマによるクリーン化技術

栃久保 文嘉 (首都大学東京)

8. WOW を用いた三次元積層技術

～エッチングに優しい三次元量産技術の世界～

大場 隆之 (東京大学)

参加費：テキスト代を含む。括弧内は学生。

● 応物・PE 分科会個人会員 30,000 円(8,000 円)

● 応物個人会員 33,000 円(11,000 円)

● 分科会のみ個人会員 42,000 円(15,000 円)

● 協賛学協会・応物法人賛助会員

42,000 円(15,000 円)

● その他

45,000 円(18,000 円)

なお、非会員の方でも参加申込時に PE 分科会(年会費 3,000 円)に入会頂ければ、会員扱いとさせていただきます。

定員：100 名(定員になり次第締切り)

申込締切：10月15日(金)(但し、余裕のある場合には期日後も受け付けます)

申込方法：

詳細はプラズマエレクトロニクス分科会ホームページに後日掲載します。

<http://annex.jsap.or.jp/support/division/plasma/>

参加費振込先：

三井住友銀行 本店営業部 普通預金

口座番号 3339808

(社) 応用物理学会 プラズマエレクトロニクス分科会

(参加費振込期限：10月20日(水))

問合せ先：

〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1

東京大学大学院 工学系研究科マテリアル工学専攻 神原淳

TEL/FAX: 03-5841-7099

e-mail: JSAP-PE-lecture@plasma.t.u-tokyo.ac.jp

担当幹事：

小杉直貴(パナソニック)、原島啓一(ルネサスエレクトロニクス)、仲村恵右(三菱電機)、木下啓藏(NEC)、中西敏雄(TEL-AT)、三宅賢稔(日立)、南正樹(ソニー)、栗原一彰(東芝)、清水一男(静岡大学)、神原淳(東京大学)